

PROVVEDIMENTO

OGGETTO: *NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SENSI DELL'ART. 93 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 N. 36 PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE ALLA GARA INDETTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE DI UN SISTEMA DI RIMOZIONE DI MATERIALI IN PLASMA DELLA TIPOLOGIA RIE REACTIVE ION ETCHING NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 3.1 DEL¹ PROGETTO NFFA-DI CUP B53C22004310006 CIG A02B3C5E93*

LA DIRETTRICE

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 rubricato "Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 12 della GU n. 77 del 31 marzo 2023 (nel seguito per brevità "Codice") e, in particolare, gli artt. 51 e 93;

VISTO il provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Progetto (nel seguito RUP) prot. n. 0350673 del 16/11/2023;

VISTO il provvedimento di decisione di contrattare e approvazione degli atti di gara prot. n. 0357037 del 21/11/2023 con cui la Stazione appaltante Istituto di Fotonica e Nanotecnologie ha indetto la gara di cui trattasi;

VISTO il bando di gara pubblicato sulla GURI 5° Serie Speciale n. 136 del 24/11/2023 con termine per la presentazione delle offerte alle ore 17:00 del 14/12/2023;

CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, commi 1 e 2, del Codice individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

VISTO l'art. 93, comma 1, del Codice a tenore del quale la nomina della commissione giudicatrice deve avvenire dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

VISTA la richiesta pervenuta dal RUP con la quale è stata avanzata la richiesta di svolgimento, da parte della nominanda commissione, delle attività di supporto alla verifica dell'anomalia delle offerte;

CONSIDERATO che, entro il termine indicato nei documenti di gara e come si evince dal verbale del seggio di gara nr. 1 del 14/12/2023, sono stati ammessi alla fase di apertura e valutazione delle offerte tecniche, le offerte dei concorrenti indicati nella tabella sottostante:

Lotto	Denominazione concorrente
sistema per la rimozione di materiali in plasma delle tipologie RIE Reactive Ion Etching sistema per la rimozione di materiali in plasma delle tipologie RIE Reactive Ion Etching	G. GAMBETTI KENOLOGIA SRL

CONSIDERATA la necessità di dover procedere alla nomina della commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 93 del Codice;

CONSIDERATO che ai sensi del medesimo articolo, la commissione sarà presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali, ivi compreso il RUP. Solo in mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni;

VISTO l'art. 20 del Disciplinare di gara che dispone “[...] *La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione. [...]*”;

VISTI i nominativi individuati per la composizione della commissione giudicatrice come di seguito:

- 1^a componente con funzioni di presidente dott.ssa Lorenza Ferrario;
- 2^a componente con funzione di commissario effettivo dott. ssa Caterina Vozi;
- 3^a componente con funzione di commissario effettivo dott. Alessandro Chiasera;
- segretario verbalizzante dott.ssa Alessandra Brocca;

CONSIDERATO:

- Che è stata acquisita la disponibilità da parte dei suddetti componenti;
- Che sono stati altresì acquisiti i relativi curricula, che si pubblicano, in allegato al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del Codice;
- Che sono state acquisite agli atti del procedimento le dichiarazioni di inesistenza delle cause ostative alla nomina di cui all'art. 93, comma 5, del Codice ivi inclusa quella del RUP;

VISTE le dichiarazioni (allegate al presente atto) di assenza di conflitto d'interessi, nonché di disponibilità e compatibilità a ricoprire i ruoli di componente della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate dagli OO.EE. partecipanti alla gara per l'affidamento di un sistema di rimozione di materiali in plasma della tipologia rife Reactive Ion Etching rese da parte di tutti i componenti la commissione giudicatrice;

DISPONE

1. **LA NOMINA**, ai sensi dell'art. 93 del Codice della commissione giudicatrice, con il compito di selezionare la migliore offerta nonché di essere di supporto al RUP per l'eventuale verifica di anomalia, con la seguente composizione:
 - 1^a componente con funzioni di presidente dott.ssa Lorenza Ferrario;
 - 2^a componente con funzione di commissario effettivo dott.ssa Caterina Vozi;
 - 3^a componente con funzione di commissario effettivo dott. Alessandro Chiasera;
 - segretario verbalizzante dott.ssa Alessandra Brocca;
2. **DI STABILIRE** che la partecipazione ai lavori della commissione è a titolo gratuito per tutti i componenti;
3. **DI NOTIFICARE** copia del presente provvedimento a ciascun componente della commissione giudicatrice;
4. **LA PUBBLICAZIONE** nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della composizione della commissione giudicatrice e dei curricula dei suoi componenti.

La Direttrice CNR-IFN

Dott.ssa Caterina Vozi